

# Geneigte Rotierende Plasmaunterstützte Chemische Abscheidung Pecvd-Rohrfenmaschine

Artikelnummer: KT-PE16



## Einführung

Fortschrittlicher PECVD-Rohrfen für die präzise Dünnschichtabscheidung. Gleichmäßige Heizung, RF-Plasmaquelle, anpassbare Gassteuerung. Ideal für die Halbleiterforschung.

[Mehr erfahren](#)

Modell des Ofens	PE-1600-60
Max. Temperatur	1600°C
Konstante Arbeitstemperatur	1550°C
Material des Ofenrohrs	Hochreines Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Rohr
Durchmesser des Ofenrohrs	60 mm
Länge der Heizzone	2x300mm
Material der Kammer	Japanische Tonerdefaser
Heizelement	Molybdän-Disilizid
Heizrate	0-10°C/min
Thermisches Paar	Typ B
Temperaturregler	Digitaler PID-Regler/PID-Regler mit Touchscreen
Genauigkeit der Temperaturregelung	±1°C
RF-Plasma-Gerät	
Ausgangsleistung	5 -500W einstellbar mit ± 1% Stabilität
RF-Frequenz	13,56 MHz ±0,005% Stabilität
Reflexionsleistung	350W max.
Anpassung	Automatisch
Rauschen	<50 dB
Kühlung	Luftkühlung.
Gasgenaue Kontrolleinheit	
Durchflussmesser	MFC-Massendurchflussmesser
Gas-Kanäle	4 Kanäle
Durchflussmenge	MFC1: 0-5SCCM O <sub>2</sub> MFC2: 0-20SCCM H <sub>4</sub> MFC3: 0- 100SCCM H <sub>2</sub> MFC4: 0-500 SCCM N <sub>2</sub>
Linearität	±0,5% F.S.

Reproduzierbarkeit	±0,2% V.E.
Rohrleitung und Ventil	Rostfreier Stahl
Maximaler Betriebsdruck	0,45MPa
Steuerung des Durchflussmessers	Digitaler Drehknopf-Controller/Touchscreen-Controller
<b>Standard-Vakuumeinheit (optional)</b>	
Vakuumpumpe	Drehschieber-Vakuumpumpe
Durchflussmenge der Pumpe	4L/S
Vakuum-Sauganschluss	KF25
Vakuummeter	Pirani/Resistance Silikon-Vakuummeter
Nennvakuumdruck	10Pa
<b>Hochvakuumeinheit (optional)</b>	
Vakuumpumpe	Drehschieberpumpe+Molekularpumpe
Durchflussmenge der Pumpe	4L/S+110L/S
Vakuum-Sauganschluss	KF25
Vakuummeter	Zusammengesetztes Vakuummeter
Nennvakuumdruck	6x10-5Pa
Die oben genannten Spezifikationen und Konfigurationen können kundenspezifisch angepasst werden.	

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Ofen	1
2	Quarzrohr	1
3	Vakuumflansch	2
4	Thermoblock der Röhre	2
5	Rohr Thermoblockhaken	1
6	Hitzebeständiger Handschuh	1
7	RF-Plasmaquelle	1
8	Präzise Gassteuerung	1
9	Vakuumeinheit	1
10	Betriebsanleitung	1